

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
【部門区分】第3部門第4区分  
【発行日】令和3年6月17日(2021.6.17)

【公開番号】特開2020-19994(P2020-19994A)  
【公開日】令和2年2月6日(2020.2.6)  
【年通号数】公開・登録公報2020-005  
【出願番号】特願2018-144174(P2018-144174)  
【国際特許分類】

C 2 3 C 14/04 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 14/04 A

【手続補正書】

【提出日】令和3年4月26日(2021.4.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

多数独立の蒸着通孔(9)からなる蒸着パターンを備えるマスク本体(2)と、マスク本体(2)が配置されるマスク開口(5)を有する補強用の枠体(3)とを備える蒸着マスクであって、

枠体(3)は、相対的に引張強度が高く変形し難い難変形部と、相対的に引張強度が低く変形し易い易変形部とを含み、

枠体(3)の少なくとも難変形部に、引張強度を低下させるための強度低下部(14)が形成されていることを特徴とする蒸着マスク。